

フロントページの続き

Fターム(参考) 20362 BA64 BA66 BA68 BA71 BA83

CA09 CB07 CB08 CB12

2H041 AA07 AA08 AA13 AB14 AC06

AZ02

2H106 AA12 AA71 BH00

5C072 AA03 BA02 BA16 DA04 DA23

FB28 HB08 XA01

F - 3

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2001-133893 (P2001-133893A)

(43)公開日 平成13年5月18日(2001.5.18)

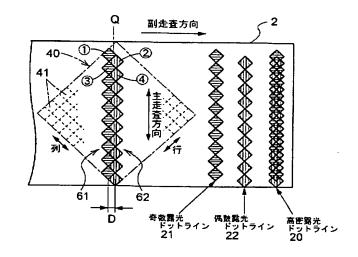
| (51) Int.Cl.7 | 識別記号 | F Ι | テーマコージ(参考) |
|---------------|-----------------------|------------------|--------------------|
| G03B 2 | 7/32 | G 0 3 B 27/32 | G 2C362 |
| B41J | 2/44 | G 0 2 B 26/08 | E 2H041 |
| G02B 2 | 6/08 | B 4 1 J 3/00 | D 2H106 |
| H 0 4 N | 1/113 | H 0 4 N 1/04 | 104Z 5C072 |
| | | 審査請求 未請求 | 請求項の数6 OL (全 11 頁) |
| (21)出願番号 | 特願平11-313786 | (71)出願人 00013531 | 3 |
| | | ノーリツ | 鋼機株式会社 |
| (22)出願日 | 平成11年11月4日(1999.11.4) | 和歌山県 | 和歌山市梅原579番地の1 |
| | | (72)発明者 森田 彰 | 郎 |
| | | 和歌山県 | 和歌山市梅原579番地の1 ノー |
| | | リツ鋼機 | 株式会社内 |
| | | (72)発明者 石井 智 | 之 |
| | | 和歌山県 | 和歌山市梅原579番地の1 ノー |
| | | リツ鋼機 | 株式会社内 |
| | | (74)代理人 10010730 | 8 |
| | | 弁理士 | 北村 修一郎 (外1名) |
| | | | 最終頁に続く |
| | | i | |

(54) 【発明の名称】 ライン露光式画像形成装置

(57)【要約】

【課題】コストの上昇を抑えつつ解像度を向上させる、 マイクロミラーデバイスを用いたライン露光式画像形成 装置を提供する。

【解決手段】光源から入射した光を感光材料2の所定露 光位置に反射させる傾斜可能な多数のマイクロミラー4 1を配置したマイクロミラーデバイス40と、前記露光 位置に対して感光材料を相対移動させる副走査移動機構 とを備えたライン露光式画像形成装置において、前記記 イクロミラーデバイスの所定列のマイクロミラーの前記 感光材料上における結像位置を結ぶ仮想ラインが前記相 対移動方向に対して傾斜するように前記マイクロミラーデバイスを配置するとともに、前記感光材料に前記相対 移動方向に直交する主走査方向の露光ドットラインが 記マイクロミラーデバイスの列方向に対して傾斜する方 向で選択されたマイクロミラーからなる主走査ミラーセット61によって作り出されることを特徴とする。



【特許請求の範囲】

【請求項1】光源から入射した光を感光材料の所定の露光位置に反射させる露光姿勢と前記感光材料以外のところに反射させる非露光姿勢との間で傾斜可能な多数のマイクロミラーを複数の行と列をもつマトリックスで置したマイクロミラーデバイスと、前記露光位置に対対に感光材料を相対移動させる副走査移動機構と、画像信号に応じて前記マイクロミラーの姿勢を制御するミラー制御部とを備えたライン露光式画像形成装置において、前記マイクロミラーデバイスの所定列のマイクロミラーがが記感光材料上における結像位置を結ぶ仮想ラインが前記相対移動方向に対して傾斜するように前記マイクロミラーデバイスを配置するとともに、

前記感光材料に前記相対移動方向に直交する主走査方向 の露光ドットラインが、前記マイクロミラーデバイスの 列方向に対して傾斜する方向で選択されたマイクロミラ ーからなる主走査ミラーセットによって作り出されるこ とを特徴とするライン露光式画像形成装置。

【請求項2】前記主走査ミラーセットが、前記マイクロミラーデバイスの対角線に沿う方向で選択されたマイクロミラーからなることを特徴とする請求項1に記載のライン露光式画像装置。

【請求項3】前記マイクロミラーデバイスがm行n列、m<nのマトリックスでマイクロミラーを配置したものであり、かつ前記主走査ミラーセットが、前記マイクロミラーデバイスの列方向に対して45度傾斜する方向で所定個ずつ選択されたマイクロミラーを有する多数のサブセットからなることを特徴とする請求項2に記載のライン露光式画像形成装置。

【請求項4】前記マイクロミラーデバイスがm行n列、mくnのマトリックスでマイクロミラーを配置したものであり、かつ前記主走査ミラーセットが、前記マトリックスの対角線の一端部から出発して前記マイクロミラーデバイスの列方向に対して45度傾斜する方向で所定個ずつ選択されたマイクロミラーを有する第1サブセットと、前記対角線の他端部から出発して前記マイクロミラーでバイスの列方向に対して45度傾斜する方向で所定個ずつ選択されたマイクロミラーを有する第2サブセットとからなることを特徴とする請求項1に記載のライン露光式画像形成装置。

【請求項5】前記主走査ミラーセットを3つ以上設定し、カラー露光において単一の露光ドットを異なるマイクロミラーによる重ね打ちによって作り出すことを特徴とする請求項1~4のいずれかに記載のライン露光式画像形成装置。

【請求項6】前記主走査ミラーセットと、この主走査ミラーセットのマイクロミラーによって作り出される各露 光ドットの間に露光ドットを作り出すマイクロミラーからなる補間主走査ミラーセットとによってより高解像度 な露光ドットラインが作り出されることを特徴とする請 求項1~5のいずれかに記載のライン露光式画像形成装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、光源から入射した 光を感光材料の所定の露光位置に反射させる露光姿勢と 前記感光材料以外のところに反射させる非露光姿勢との 間で傾斜可能な多数のマイクロミラーを複数の行と列を もつマトリックスで配置したマイクロミラーデバイス と、前記露光位置に対して感光材料を相対移動させる副 走査移動機構と、画像信号に応じて前記マイクロミラー の姿勢を制御するミラー制御部とを備えたライン露光式 画像形成装置にに関するものである。

[0002]

【従来の技術】マイクロミラーデバイスは、DMD (Digital Micromirror Device) とも呼ばれ、ウェハー上にアルミスパッタリングで作り込まれた、反射率の高いー辺が約16ミクロンの正方形マイクロミラーを静電界作により動作させるタイプのデバイスで、このマイクロミラーはCMOS半導体技術により、シリコン・メモリップの上にマトリックス状に約数十万~百万個敷まやサールに安定した2つの姿勢、水平方向に対して±10度程度に回転傾斜することができる。通常、このマイクロミラーデバイスは各マイクロミラーを1画素として、光原からの光の反射時間を制御することで、スクリーン上にディジタル映像を投影するデジタル・ディスプレイ・システムに採用されている。

【0003】しかしながら、この2つの安定した姿勢の1つにおいて、光源からの光を感光材料の所定位置に照射するように反射し、他の姿勢において光源からの光を感光材料領域外に反射するように設定することで、感光材料の任意の位置に露光ドットを形成することができる。さらに、露光ドットを作り出す際の照射時間を制することにより、この露光ドットに任意の階調度を与えることが可能となり、マイクロミラーの照射位置に対料を相対的に移動させることにより感光材料を相対的に移動させることにより感光材料に画像を形成するライン露光式画像形成装置にも採用することが可能である。例えば、そのような画像形成装置は、特開昭10-104753号公報から知られている。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら上記従来 構成では、デジタル・ディスプレイ・システムに採用さ れているマイクロミラーデバイスを流用しているので、 このマイクロミラーデバイスが必ずしもライン露光式画 像形成装置にとって最適なものではない。例えば、感光 材料に形成される露光ドット画像解像度はマイクロミラ ーデバイスのミラー集積度で決定され、XGAの画面解 像度を実現するマイクロミラーデバイスでは、縦768 画素、横1024画素であり、長い方の横列をライン露 光のラインに使用したとしても、感光材料として幅10 0mmの印画紙を使った場合、その解像度は250dpi 程度となり、より高い解像度の要求に応えることはでき ない。同一のマイクロクロミラーデバイスを2つ使用す ることにより、解像度を倍にすることができるが、コストの上昇が大きすぎる。上記実状に鑑み、本発明の課題 は、コストの上昇を抑えつつ解像度を向上させる、マイクロミラーデバイスを用いたライン露光式画像形成装置 を提供することである。

[0005]

【課題を解決するための手段】上記課題を解決するた め、本発明では、光源から入射した光を感光材料の所定 の露光位置に反射させる露光姿勢と前記感光材料以外の ところに反射させる露光姿勢との間で傾斜可能な多数の マイクロミラーを複数の行と列をもつマトリックスで配 置したマイクロミラーデバイスと、前記露光位置に対し て感光材料を相対移動させる副走査移動機構と、画像信 号に応じて前記マイクロミラーの姿勢を制御するミラー 制御部とを備えたライン露光式画像形成装置において、 前記マイクロミラーデバイスの所定列のマイクロミラー の前記感光材料上における結像位置を結ぶ仮想ラインが 前記相対移動方向に対して傾斜するように前記マイクロ ミラーデバイスを配置するとともに、前記感光材料に前 記相対移動方向に直交する主走査方向の露光ドットライ ンが、前記マイクロミラーデバイスの列方向に対して傾 斜する方向で選択されたマイクロミラーからなる主走査 ミラーセットによって作り出されることを特徴としてい る。

【0006】この構成では、矩形のマイクロミラーデバイスを斜めにして、露光ラインとして縦列(行方向)のマイクロミラーでも横列(列方向)マイクロミラーでもなく、斜めの線に沿って位置するマイクロミラーを利用するので、縦列や横列よりも多いの個数のマイクロミラーを露光ラインとして使用することが可能となる。

【0007】露光ラインに対して最も多くの個数のマイクロミラーを割り当てるには、例えば、矩形のマイクロミラーデバイスの対角線の沿って位置するマイクロミラーを利用するようにするとよい。これにより、その対角線周辺に位置する多数のマイクロミラーが画素ずらしの位置関係となり、プリント時に使用するマイクロミラーを適切に選択することで解像度を飛躍的に向上させる道が切り開ける。

【0008】前述した、露光ラインに使用するマイクロミラーを選択する際の基準となる斜めの線を45度にすると、各マイクロミラーから反射される光ビームの輝度分布の重なり合いが均等化されるので都合がよい。したがって、本発明の好適な実施形態の1つでは、長方形のマイクロミラーデバイス、つまりマイクロミラーデバイスがm行n列、m<nのマトリックスでマイクロミラー

を配置したものである場合、かつ前記主走査ミラーセッ トを、前記マイクロミラーデバイスの列方向に対して4 5度傾斜する方向で所定個ずつ選択されたマイクロミラ 一を有する多数のサブセットから構成されるようにして いる。サブセットが作り出す露光ドットラインどうし は、感光材料の相対移動方向(一般には副走査方向と呼 ばれている) にずれることになるが、マイクロミラーに 対する副走査方向での駆動タイミング制御技術で実際の 感光材料には一直線の露光ドットラインを形成すること ができる。各サブセットのマイクロミラーは45度の傾 斜線に沿っているので、反射される光ビームの輝度分布 の重なり合いが均等化している。また、多数のサブセッ トに分割されているのでサブセットどうしのずれも小さ いものとなり、もし光源の輝度分布にむらがあっても隣 り合う露光ドットを形成するマイクロミラーに入射する 光ビームの輝度差はほとんど無視できる。

【0009】また、光源の輝度分布むらが気にならない場合、前述したような長方形マイクロミラーデバイスを表すの別な実施形態の1つとして、前記主義である本発明の別な実施形態の1つとして、前記主義である方向でが、長方形の対角線の一端部から出発を支援する方向で所定個ずつ選択されたマイクロミラーデバイスの列方向に対して45を有する第1サブセットと、前記対角線の他端部対して45を有いが記する方向で所定個ずつ選択されたマイクロミラーデバイスの列方に対して45を有する第2サブセットとから構成されるものが提案がある。この構成では、サブセットの数が2つだけであります。この構成では、サブセットの数が2つだけであります。この構成では、サブセットの数が2つだけでありますが作り出す露光ドットラインの副走査方向でのずれを吸収するためのマイクロミラーのタイミング制御が簡単となる。

【0010】さらに別な本発明の好適実施形態では、前記主走査ミラーセットを3つ以上設定し、カラー露光において単一の露光ドットを異なるマイクロミラーによる重ね打ちによって作り出している。これにより、色されが抑制された品質の高いカラー露光ドットが形成される。またその際、、前記主走査ミラーセットを4つ以上、少なくくのは3の倍数だけ設定し、カラー露光において少なくくりも10の、好ましくは3色の露光ドットを異なるマイクロミラーによる重ね打ちによって作り出すように構成するなのでよる重ね打ちによって作り出すように構成するなのマイクロミラーに分割することができるので、副走査方向の移動速度、つまり露光処理速度を高めることができる。

【 O O 1 1 】さらに別な本発明の好適実施形態では、前記主走査ミラーセットと、この主走査ミラーセットのマイクロミラーによって作り出される各露光ドットの間に露光ドットを作り出すマイクロミラーからなる補間主走査ミラーセットとによってより高解像度な露光ドットラインが作り出されるように構成されている。この構成

イクロミラーが画素ずらしの位置関係となり、これらのマイクロミラーを適切に利用することで解像度を飛躍的に向上させることができきる。このような趣旨から、図4では、主走査ミラーセット61に隣接するマイクロミラー4から補間主走査ミラーセット62が設定されている。

【0019】ここで、主走査ミラーセット61と補間主 走査ミラーセット62を構成するマイクロミラー41を 図面において上から順に1番、2番、3番、4番・・・ (図では単に丸数字で表示) と名付けると、主走査ミラ ーセット61を構成するマイクロミラーセットは奇数の 番号を持つことになり、補間主走査ミラーセット62を 構成するマイクロミラーセットは偶数の番号を持つこと になる。このため、主走査ミラーセット61の全てのマ イクロミラー41を露光傾斜姿勢にすると、全ての奇数 番のマイクロミラー41によって反射された光ビームに よる露光ドットラインが形成されるので、この露光ライ ンを奇数露光ドットライン21と呼ぶことにする。そし て、補間主走査ミラーセット62の全てのマイクロミラ 一41を露光傾斜姿勢にすると、全ての偶数番のマイク ロミラー41によって反射された光ビームによる露光ド ットラインが形成されるので、この露光ラインを偶数露 光ドットライン22と呼ぶことにする。

【0020】主走査ミラーセット61と補間主走査ミラーセット62の副走査方向で間隔:Dだけずれているない。 神間主走査ミラーセット62による露光ドットがなる時間だけずれているない。 ウェングをその間隔:Dに相当する時間だけがられるで、ちょうど奇数露光ドットライン21と偶数露光ドットライン22を重ね合わすことができまして形成された。 おいま できる。このようにして形成された。 京田 といれ できる。このようにして形成された。 常田 といれ できる。このようにして形成された。 常田 といれ できる。このようにして形成された。 常田 といれ できる。このようにして形成された。 できる。このようにして形成された。 できる。このようにして形成された。 とのは、 おとには、 2倍の解像度をもつ。 を形成すり、この高密露光ドットライン20を用いて画像を形成すり、この高密露光ドットラインと神間主走査ミラーセット61と補間主走査ミラーセット61と神間主きでいまる。

【0021】前述したようにマイクロミラーデバイス40はデジタルディスプレイ素子として流通していることから、通常入手できる形状は図5に示すような、m行n列、但しmくn、のマトリックスでマイクロミラー41を配置した長方形である。

【0022】この長方形形状を最大限に生かすため、ここでの主走査ミラーセット41は、長方形の対角線の一端部から出発してマイクロミラーデバイス40の列方向に対して45度傾斜する方向:Qで所定個ずつ選択されたマイクロミラー41を有する第1サブセット61aと、この対角線の他端部から出発して前記マイクロミラーデバイスの列方向に対して45度傾斜する方向で所定

個ずつ選択されたマイクロミラー41を有する第2サブセット61bとから構成されている。上記所定個とは、第1サブセット61bによってのと第2サブセット61bによってのないラインとなるように決定される。第1サブセット61bは間隔:D1だけ間隔をあけることになるので、印画紙2に直線状の露光ドットラインを形成するにはそれぞれの露光のタイミングを形成するにはそれぞれの露光のタイミングを時間ずらさなければならない。ここでも、第1サブセット62aと第2サブセット62bから構成される補間主走査ミラーセット62が設定されている。

【0024】図7に示されたマイクロミラーデバイス4 Oでは、全体として長方形の対角線の方向に延びている 主走査ミラーセット61を構成する各サブセット61 a、61b・・が、形成される露光ドットが直線状につ ながるようにマイクロミラーマトリックスの所定行から 選択されている。この主走査ミラーセット61で作り出 される各露光ドットの隣同士の重なりは、先に説明した 主走査ミラーセット61と補間主走査ミラーセットとが 作り出す露光ドットとは違って、ばらつくことになる が、露光ドットの大きさが非常に小さいこともあって、 それほどの画像品質の低下を引き起こさない。ただし、 各サブセット61a、61b・・を構成するマイクロミ ラー41が副走査方向に関して間隔:D3 ずつずれてい るので、印画紙2に直線状の露光ドットラインを形成す るにはそれぞれの露光のタイミングを所定時間ずらすず らし制御を行う。

【0025】図8に示されたマイクロミラーデバイス40では、主走査ミラーセット61を構成する各マイクロミラー41が、長方形マイクロミラーデバイス40の対角線にできるだけ近接するように、かつ形成される露光ドットが直線状につながるように選択されている。主走査ミラーセット61を構成するマイクロミラー41の数は多くなり、結果的には高解像度が得られるが、マイクロミラー41同士の副走査方向に関するずれは微妙にず

れているので、きめ細かいずらし制御で調整することになる。

【0026】次に、主走査ミラーセット61と補間ミラーセット62からなるプリントヘッドラインを3つ備えて、R・G・Bの各露光ドットを完全に重ねてカラー画像を形成する露光処理過程を図9~図11を用いて説明する。図9は第1プリントヘッドラインL1、第2プリントヘッドラインL2、第3プリントヘッドラインL3が設定されているマイクロミラーデバイス40を使って説明である。このマイクロミラーデバイス40を使って説明を簡単にするため、各プリントヘッドラインとも1番~4番のマイクロミラー41だけで説明される。

【0027】図10(イ) マイクロミラーデバイス40の制御は、回転フィルタ52の回転とタイミングをとって行われ、赤:Rの光ビームをマイクロミラーデバイス40に入射させている。ここでは、第1プリントヘッドラインL1の奇数番号、つまり1番と3番のマイクロミラー41のみが露光姿勢に傾斜され、他のマイクロミラーは非露光姿勢に傾斜される。これにより印画紙2の第1ラインには第1プリントヘッドラインL1による赤色奇数露光ドットラインが形成される。

【0028】図10(ロ) 第1プリントヘッドライン L1の偶数番号、つまり2番と4番のマイクロミラー4 1のみが露光姿勢に傾斜され、他のマイクロミラーは非 露光姿勢に傾斜される。これにより印画紙2の第1ラインには第1プリントヘッドラインL1による赤色偶数露 光ドットラインが形成され、結果として印画紙の第1ラインは赤色高密露光ドットラインとなる。

【0029】図10(ハ) ここでは、回転フィルタ52の赤色フィルタ領域が光軸から過ぎ去り、緑色フィルタ領域が光軸に入り、緑:Gの光ビームをマイクロミラーデバイス40に入射させている。第1プリントへッドラインし1と第2プリントへッドラインし2の奇数番号のマイクロミラー41のみが露光姿勢に傾斜され、他のマイクロミラーは非露光姿勢に傾斜される。これにより印画紙2の第1ラインには第1プリントへッドラインし1による緑色奇数露光ドットラインが形成される。

【0030】図11(二) 第1プリントヘッドラインL1と第2プリントヘッドラインL2の偶数番号のマイクロミラー41のみが露光姿勢に傾斜され、他のマイクロミラーは非露光姿勢に傾斜される。これにより印画紙2の第1ラインには第1プリントヘッドラインL1による緑色偶数露光ドットラインが形成され、印画紙2の第2ラインには第2プリントヘッドラインL2による緑色偶数露光ドットラインが形成される。

【 0 0 3 1 】 図 1 1 (木) ここでは、回転フィルタ 5 2 の緑色フィルタ領域が光軸から過ぎ去り、青色フィル タ領域が光軸に入り、青:Bの光ビームをマイクロミラーデバイス40に入射させている。第1プリントへップリントへッドラインL1と第2プリントへッドラインL2と第3プリントへッドラインL3の奇数番号のマイクロミラー41のみが露光姿勢に傾斜され、他のマイクロミラーは非露光姿勢に傾斜される。これにより印画紙2の第1ラインには第1プリントへッドラインL1による青色奇数露光ドットラインが形成され、印画紙2の第3ラインには第3プリントへッドラインL3による青色奇数露光ドットラインが形成され、印画紙2の第3ラインには第3プリントへッドラインL3による青色奇数露光ドットラインが形成される。

【0032】図11(へ) 第1プリントヘッドラインL1と第2プリントヘッドラインL2と第3プリントへッドラインL3の偶数番号のマイクロミラー41のみが露光姿勢に傾斜され、他のマイクロミラーは非露光姿勢に傾斜される。これにより印画紙2の第1ラインには第1プリントヘッドラインL1による青色偶数露光ドットラインが形成され、印画紙2の第2ラインには第2プリントヘッドラインL2による青色偶数露光ドットラインが形成され、印画紙2の第3ラインには第3プリントへッドラインL3による青色偶数露光ドットラインが形成される。この結果、印画紙2の第1ラインには、R・G・B全色の光ビームによる高密露光ドットラインが形成されたことになり、第1ラインのカラー露光が完了する。

【0033】以後は、図11(ホ)と(へ)のミラー動作を各露光色について繰り返していき、最終段階では、図10(イ)~(ハ)及び図11(二)の手順を逆に行って、全ての画像の露光を完了する。なお、上述した露光処理において、マイクロミラーの露光姿勢の保持時間を例えば、8bit、256段階で調整することで、24bitフルカラー画像が形成される。

【0034】上記の例では、各色の露光のための1つのプリントヘッドラインしか設定されていなかったが、1色の露光のために複数のプリントヘッドラインを設定したマイクロミラーデバイス40を使用した場合、同様なずらし制御により、同じ位置の1つの色の露光ドットを形成するために複数のマイクロミラー41による露光が可能になるので、マイクロミラー1個当たりに割り当てられる露光時間は短くなり、露光処理の高速化を可能にする。

【0035】次に、本発明による露光エンジン4を備えたライン露光式画像形成装置の一例としての銀塩写真デジタルプリンタについて、図を用いて説明する。図12には、この銀塩写真デジタルプリンタの外観斜視図、図13にはその概略ブロック図が示されている。この銀塩写真デジタルプリンタは、写真フィルム1のコマ画像をデジタル画像データとして取得するフィルムスキャナー3と、取得されたデジタル画像データ(以後単に画像デ

ータと称す)を処理してプリントデータを作成するコントローラ6と、このプリントデータに基づいて感光材料をしての印画紙2にコマ画像に対応する画像を露光するDMD式露光エンジン4と、露光された印画紙2を備えている。現像処理部5とを備えている。現像処理部5とを備えている。現像処理部5とを備えている。フィルムとして排出される。図番7は異なる仕上がリプリントとして排出される。図番7は出るしてがリプリントとして排出される。フィルムスキャナー3に搬送するフィガジンコンとといる。であり、図番8は印画紙2をペーパーマガジンコンのに送り込む印画紙とを終えた印画紙と表機構であり、高なおされている。なおされている。なおされている。なおされている。なおされている。なおされている。なおされている。なおされている。と機構をは、この印画紙2を搬送する副走査搬送部8aを備えている。

【0036】コントローラ6には、各種処理情報を表示するモニター6 a や各種処理命令を入力するための操作卓6 b、さらにはメモリーカードやMOやFDなどの画像データ記録メディアから画像データを受け付けたり、通信回線を介して伝送されてくるデジタル画像データを受け付ける外部画像入力部6 cが接続されている。この外部画像入力部6 cが設けられていることにより、この外部画像入力部6 cが設けられていることにより、この写真フィルムだけでなく、デジタルカメラによって撮像された画像や、コンピュータグラフィックソフトなどで作成されたCG画像をも取り扱うことができる。

【0037】フィルムスキャナ3は、発生させた光ビームの色分布や強度分布を整えてフィルム1を照射する照明光学系3aと、フィルム1からの透過光ビームを光学的に処理する撮像光学系3bと、撮像光学系3bによって導かれた光ビームをスリット画像としての電荷画像に光電変換する光電変換部3cから構成されている。

【0038】光電変換部3cは、それ自体公知の、CC Dセンサユニット、サンプルホールド(S/H)回路、 A/D変換器、センサ駆動回路などから構成されてい る。CCDセンサユニットは、3つのCCDセンサから 構成され、各CCDセンサは多数(例えば5000個) のCCD素子が主走査方向、つまりフィルム1の幅方向 に配列されたラインセンサであり、センサ駆動回路によ り主走査時に電荷蓄積動作や電荷蓄積時間の制御が行わ れる。各CCDセンサの撮像面には、それぞれ光ビーム の青色成分、赤色成分、緑色成分のみを通過させるカラ ーフィルタが設けられており、それぞれ、青色成分、赤 色成分、緑色成分のみを光電変換する。サンプルホール ド回路は、それぞれのCCDセンサから出力される各画 素信号をサンプルホールドして各画素信号が連続した画 像信号を生成するものであり、A/D変換器は、画像信 号を構成する各画素信号を所定のビット数(例えば12 ビット)のデジタル信号に変換するものである。このよ うにして光電変換部3cで取得されたR・G・B信号と

してのデジタル画像データはコントローラ6へ送られる。

【0039】印画紙2は、印画紙マガジン10にロール 状態で収納されており、ここでは図示されていないカッターによってプリントサイズに応じて適正長さに切断されて露光エンジン4で露光される。露光された印画紙2は、振り分け装置9によって1列搬送から、3列までの複列搬送に振り分けられて、現像処理部5に搬入される。この振り分け処理により印画紙2に対するマイクロミラーデバイス40を用いた短い露光時間と化学的処理を必要とするがゆえの現像処理部5での長い現像時間を調節する。

【0040】コントローラ6は、CPU、ROM、RAM、I/F回路などからなるマイクロコンピュータシステムを中核部材として構成され、この銀塩写真プリンタに必要な各種機能をハードウエア又はソフトウエア或いはその両方で実現させている。本発明に関連する機能を行うために、このコントローラ5には、フィルム搬送制御部、フィルムスキャナ制御部、印画紙搬送制御部、画像処理部6d、マイクロミラーデバイス制御部6eなどが構築されている。

【0041】画像処理部6dは、フィルムスキャナー3 の光電変換部3cからコントローラ6内のワーキングメ モリに送り込まれた画像データや、前述した外部画像入 力部6cから直接送り込まれたデジタルカメラによる撮 影画像データなどに対して、それ自体は公知である輪郭 強調補正、画像合成処理などの各種画像処理を行う。こ のようなデジタル画像処理は、一般には、取得されたデ ジタル画像データからプリント出力のシミュレート画像 をモニタ6aに表示し、オペレータが操作卓6bを用い てマニュアルで所望の処理を指令することも、自動的に 行うことも可能である。画像処理の終えた画像データは プリントデータに変換されてマイクロミラーデバイス制 御部6eに送られる。マイクロミラーデバイス制御部6 eは、プリントデータに基づいて、プリントヘッドとし て機能するプリントヘッドラインを構成するマイクロミ ラー41の姿勢制御を行うミラー制御部や回転フィルタ 52の回転制御を行う光源制御部などを備えており、こ れらの制御を行うことで、副走査方向に移動する印画紙 2をライン露光し、フルカラー画像を形成する。

【0042】上述した実施の形態では、マイクロミラーデバイス40の傾き、つまり主走査ミラーセットを構成するマイクロミラー41の選択するラインは、マイクロミラーマトリックス列に対して45°傾むくか、或いは、マイクロミラーマトリックスの対角線に沿った方向に傾くかのいずれかであったが、もちろんその他の任意の角度に傾かせることも本発明の枠内に入るものである。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明による画像形成装置に採用された露光エ

ンジンの模式図

【図2】マイクロミラーの構造を説明する概略斜視図

【図3】マイクロミラーによる露光状態を示す説明図

【図4】マイクロミラーデバイスにおける主走査ミラーセットと補間主走査ミラーセットの構成と露光ドットラインの様子を示す説明図

【図5】マイクロミラーデバイスにおける主走査ミラーセットと補間主走査ミラーセットの構成を示す説明図

【図6】マイクロミラーデバイスにおける主走査ミラーセットと補間主走査ミラーセットの構成を示す説明図

【図7】マイクロミラーデバイスにおける主走査ミラーセットの構成を示す説明図

【図8】マイクロミラーデバイスにおける主走査ミラーセットの構成を示す説明図

【図9】複数のプリントヘッドラインを設定したマイクロミラーデバイスを示す模式図

【図10】複数のプリントヘッドラインを用いたRGB 重ね露光処理の説明図

【図11】複数のプリントヘッドラインを用いたRGB 重ね露光処理の説明図 【図12】本発明による画像形成装置の一例としての銀 塩写真デジタルプリンタの外観斜視図

【図13】図12の銀塩写真デジタルプリンタのブロック図

【符号の説明】

2 印画紙 (感光材料)

4 露光エンジン

5 コントローラ

20 高密露光ドットライン

21 奇数露光ドットライン

22 偶数露光ドットライン

40 マイクロミラーデバイス

41 マイクロミラー

5 1 光源

52 回転フィルタ

54 コンデンサーレンズユニット

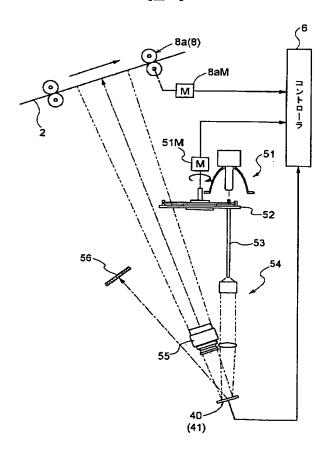
56 遮光部材

61 主走査ミラーセット

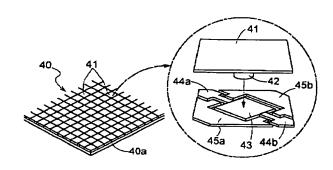
61a サブセット

62 補間主走査ミラーセット

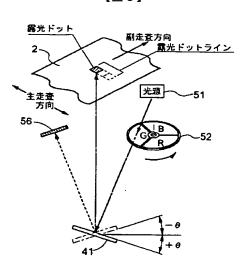
【図1】

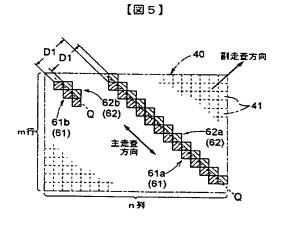


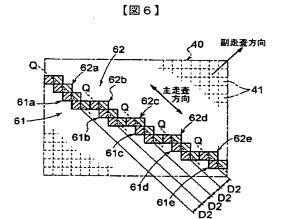
【図2】

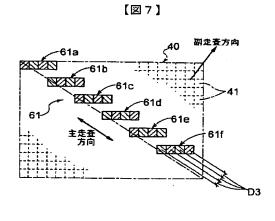


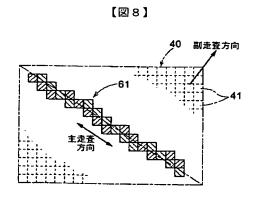
[図3]

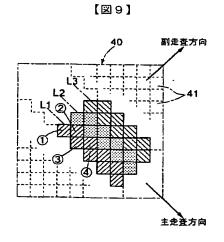


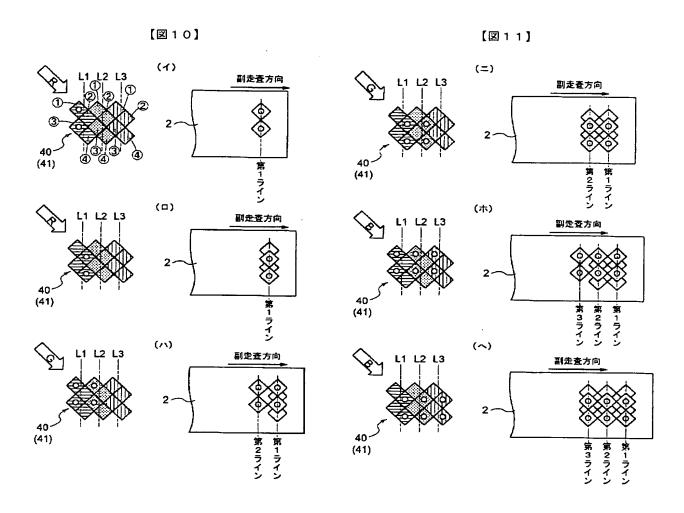






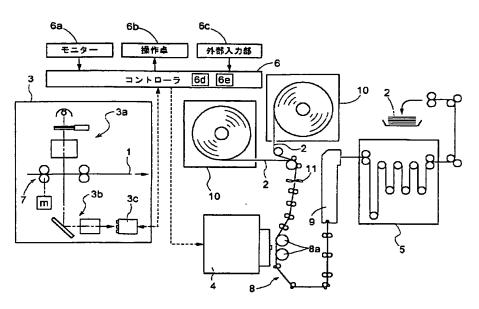






[図 1 2]





フロントページの続き

F ターム(参考) 2C362 BA64 BA66 BA68 BA71 BA83 CA09 CB07 CB08 CB12 2H041 AA07 AA08 AA13 AB14 AC06 AZ02 2H106 AA12 AA71 BH00 5C072 AA03 BA02 BA16 DA04 DA23 FB28 HB08 XA01